

ПЛАН на выполнение НИР «Исследование влияния буферных слоев на отражательные характеристики и структурные параметры многослойных систем Ru/B4C и Ru/B»

□

1. Синтез многослойных структур методом магнетронного напыления.
- 1.2. Исследование отражательных характеристик образцов в мягком рентгеновском диапазоне.
- 1.3. Определение структурных параметров структур Ru/B4C и Ru/B путем решения обратной задачи рентгеновской оптики.
- 1.4. Исследование влияния буферных слоев на коэффициент отражения зеркал Ru/B4C и Ru/B в мягком и жестком рентгеновских диапазонах длин волн.
- 1.5. Изучение адгезионных свойств многослойных структур Ru/B4C и Ru/B.

Список оборудования и услуг ЦКП ИФМ РАН для выполнения НИР «Исследование влияния буферных слоев на отражательные характеристики и структурные параметры многослойных систем Ru/B4C и Ru/B»

□

	Наименование используемого Оборудования ЦКП ИФМ РАН	Пункт из перечня услуг(работ), указанного на сайте	Наименование работы	Стоимость работ 1час (в руб)	Расчетное время работ (в час)	Цена работы (в руб)
1	Дифрактометр рентгеновский D8 Discover	п. 4	Анализ тонких слоев методом рентгеновской рефлектометрии (Bruker D8)	8 500,00	16,0	136 000,00
2	Стенд спектральных измерений на основе лазерно-плазменного источника 4-50 нм	п.7	Определение параметров многослойных зеркал в диапазоне экстремального ультрафиолета (Стенд ИФМ)	5 000,00	30,0	150 000,00
3	Стенд рентгеновской спектроскопии для диапазона 0,8-200 нм	п. 8	Определение параметров многослойных зеркал в диапазоне мягкого рентгена (Стенд ИФМ)	5 000,00	25,0	125 000,00
4	Сканирующий зондовый микроскоп Solver PRO-HV (НТ-МДТ)	п.30	Исследование морфологии поверхности методом СЗМ с использованием вакуумного оборудования с системой виброзащиты	6 600,00	20,0	132 000,00
5	Установка магнетронно-ионного напыления многослойных структур	п 42	Нанесение тонкопленочных и многослойных покрытий (до 4 различных материалов) с использованием установки магнетронно-ионного напыления многослойных структур	4 800,00	50,0	240 000,00
6	Установка магнетронного распыления	п.43	Нанесение тонкопленочных и многослойных покрытий (до 6 различных материалов) с использованием установки магнетронного напыления многослойных структур	5 600,00	110,0	616 000,00
	ВСЕГО стоимость НИР				251,0	1 399 000,00